

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：02-2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國114年6月11日

發文字號：北科大產學字第1147900165號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年半導體製程設備實務技術教師研習營課程表、114年半導體製程設備實務技術教師研習營海報 (114F900506_1_11132816335.pdf、
114F900506_2_11132816335.pdf)

主旨：檢送本校與國立高雄科技大學半導體工程系合作辦理「半導體製程設備實務技術教師研習營」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校教師踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定：「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師，每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」，辦理教師實務研習課程。
- 二、為強化技職體系師資對半導體產業製程設備的理解與實作能力，本研習營特別規劃一系列深入淺出的課程，結合理論講解與實務操作，全面提升教師教學與引導學生的專業素養。課程將從半導體製程設備基地中心介紹出發，帶領學員掌握產業脈動與最新技術應用，進一步深入製程架構



與常用設備的說明，涵蓋Loadport、真空管件、氦氣測漏儀等核心元件。實作部分設計涵蓋三大模組：1. 設備元件儀控整合實務：操作加熱載台、真空系統、曝光機與機械手臂，強化控制與機構理解。2. 黃光微影製程實務：透過曝光機製作與乾蝕刻練習，掌握微影關鍵技術。3. 真空系統操作實務：包含元件功能認識、高真空操作、系統拆裝與漏測技巧，奠定真空技術基礎。本課程透過扎實的研習與實作，期能縮短學用落差，提升教師教學與產業接軌的能力。

三、報名資格：國內各大專校院及高中職在職教師。

四、課程時間：114年8月21日（四）、8月22日（五），共計2天，凡符合報名資格且全程參與課程者，將於課程結束後擇期核發研習時數證明電子檔。

五、課程地點：國立高雄科技大學楠梓校區大仁樓半導體製程設備實務人才培育基地（集合地點：大仁樓一樓6104半導體通用技能實驗室）。

六、人數上限：實體30人。

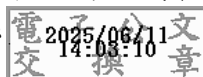
七、報名網址：<https://forms.gle/ABCKgjRCAK14GbUN9>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6020，電子郵件：
lks@mail.ntut.edu.tw

九、檢附「半導體製程設備實務技術教師研習營」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院、各國立高級職業學校、各私立高級職業學校

副本：本校產學處、國立高雄科技大學半導體工程系



114 年「半導體製程設備實務技術教師研習營」課程表

課程日期：114 年 8 月 21(四)~8 月 22 日 (五)

課程地點：國立高雄科技大學楠梓校區大仁樓半導體製程設備實務人才培育基地

(高雄市楠梓區海專路 142 號)(集合地點：大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)

報名 QR CODE

課程內容：半導體製程設備實務技術

參與對象：全國在職之技專校院教師、高中職教師/預計招收實體 30 人

報名網址：<https://forms.gle/ABCKgjRCAK14GbUN9>



課程表：

日期	時間	課程單元主題/內容/授課教師	
8/21 (四)	08:45-09:00	報 到 (集合地點：大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)	
	09:00-12:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學員為主，輪流施作不同課程)	
		1.半導體製程設備基地中心介紹 2.半導體產業應用與製程介紹 3.半導體設備工程師通用技能 Loadport、真空管件、氬氣測漏儀	國立高雄科技大學半導體工程系 楊奇達系主任 李重義教授 唐健富助理教授 陳玉鴻助理教授
	12:00-13:00	午 餐 (午休地點：大仁樓五樓 6504 階梯教室)	
	1300-17:00	課程分 A、B-2 組(每組以 15 位學員為主，輪流施作不同課程)	
		半導體設備元件儀控整合實務： 加熱載台、真空系統、曝光機機構 和程控、機械手臂等	國立高雄科技大學半導體工程系 葉旻彥教授 姚永正助理教授 侯杰利助理教授
	17:00-18:00	技術交流 Q&A	
8/22 (五) 上午	08:45-09:00	報 到 (集合地點：大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)	
	09:00-12:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學員為主，輪流施作不同課程)	
		A 組 半導體真空系統實務： 真空系統元件功能介紹、高真空系 統操作實務、真空系拆解統與組 裝、真空系統測漏實務	B 組 半導體黃光微影製程實務： 曝光機實務製作、乾蝕刻實作
		國立高雄科技大學半導體工程系 王俊凱副教授 陳玉鴻助理教授 張勝博助理教授	國立高雄科技大學半導體工程系 楊奇達系主任 唐健富助理教授 侯杰利助理教授

	12:00-13:00	午 餐 (午休地點：大仁樓五樓 6504 階梯教室)	
日期	時間	課程單元主題/內容/授課教師	
8/22 (五) 下午	13:00-17:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學員為主，輪流施作不同課程)	
		半導體黃光微影製程實務： 曝光機實務製作、乾蝕刻實作	半導體真空系統實驗室(6104)： 真空系統元件功能介紹、高真空系統操作實務、真空系拆解統與組裝、真空系統測漏實務
	17:00-18:00	國立高雄科技大學半導體工程系 楊奇達系主任 唐健富助理教授 侯杰利助理教授	國立高雄科技大學半導體工程系 王俊凱副教授 陳玉鴻助理教授 張勝博助理教授
		技術交流 Q&A (集合地點：大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)	

大仁樓一樓6104階梯教室



《位置圖》

114年半導體製程設備 實務技術教師研習營



時間：114年8月21日(四)、8月22日(五)

地點：國立高雄科技大學楠梓校區大仁樓
半導體製程設備實務人才培育基地

地主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學
國立高雄科技大學半導體工程系

